

WO 2022/157986 A1

MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

to the second exhaust line 54 and which can continuously adjust the opening degree thereof; and a pressure control device which is configured to be able to select, in order that a pressure detection value detected by a pressure detection unit comes close to a pressure set value in the treatment container set for each hour for the purpose of treatment of substrates, either one of the first valve and the second valve depending on the pressure set value, to set the opening degree of the other non-selected one of the first valve 58A and the second valve 58B to be constant, and to adjust and retain the opening degree of the selected one valve at a value greater than zero.

(57) 要約: 基板処理装置 100 は、内部において基板を処理する処理容器 20 と、処理容器 20 と排気装置 60 との間に接続され、途中で第 1 の排気ライン 52 と第 2 の排気ライン 54 とに分岐する排気路 50 と、第 1 の排気ライン 52 に設けられ、開度を連続的に調整可能な第 1 バルブ 58A と、第 2 の排気ライン 54 に設けられ、開度を連続的に調整可能な第 2 バルブ 58B と、圧力検出部が検出する圧力検出値を基板を処理するために時刻ごとに設定された処理容器内の圧力設定値に近づけるように、圧力設定値に応じて第 1 バルブ及び第 2 バルブの内の一方のバルブを選択し、第 1 バルブ 58A 及び第 2 バルブ 58B の内で選択されなかった他方のバルブの開度を一定の状態に設定すると共に、選択された一方のバルブの開度を零より大きな値に維持して調整することが可能に構成された圧力制御装置と、を備える。